

05.4; 06.1

© 1991

СПЕЦИФИКА ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОВЕДЕНИЯ
СОПРОТИВЛЕНИЯ ГЕТЕРОПЕРЕХОДА

„ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СВЕРХПРОВОДНИК –
ВЫРОЖДЕННЫЙ ПОЛУПРОВОДНИК“ В ОКРЕСТНОСТИ T_c

В.В. Б у н д а

Появление высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) открывает широкие перспективы в создании новых приборов криофотоэлектроники–гетеропереходов (ГП), включающих контактные слои сверхпроводников (СП) с полупроводниками (ПП). Важным фактором, обуславливающим перспективность использования ВТСП и ГП на их основе в фотоэлектронике, является большая величина сверхпроводящей щели $\Delta(2\Delta_0 \cong (30-60)$ мэВ) [1] и удовлетворительные значения концентраций ($p(90K) \cong 10^{18}-10^{21}$ см $^{-3}$) и дрейфовых подвижностей ($\mu_d(90K) \cong 10^4-10^6$ см 2 /В·с) носителей заряда ПП–слоев [2].

Специфика электрофизических свойств ГП „ВТСП-ПП“ значительно усиливается в области температур $T < T_c$ (T_c – температура СП–перехода), поскольку энергетический спектр элементарных возбуждений сверхпроводника претерпевает существенные изменения: в окрестности уровня Ферми E_F образуется щель $2\Delta_0$, разделяющая основные и возбужденные состояния квазичастиц. В этой связи возникает возможность эффективного обмена носителями заряда между ВТСП и полупроводником и взаимного управления их свойствами.

Как правило, нанесение на $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ (далее 123) безкислородных полупроводниковых слоев приводит к обеднению его поверхности кислородом [3, 4]. В результате у поверхности 123 образуется несверхпроводящая прослойка (в случае ГП – переходной изолирующий слой) толщиной d . В случае $d \gg \xi_n$ (где $\xi_n \cong 20$ Å – максимальное значение корреляционной длины в 123) электрические свойства контакта „ВТСП-ПП“ в основном определяются параметрами переходного слоя. При реализации условия $d \cong \xi_n$ могут быть получены туннельные структуры: переходы типа $S - I - N$ с высокими ($> 10^3 - 10^5$ Ом·см) значениями дифференциального сопротивления P_d (при напряжении смещения $V_t \rightarrow 0$) [5], либо туннельные контакты с $P_d \rightarrow 0$, базирующиеся на эффекте „ближности“ [6].

В данной работе ставилась цель разработать технологию получения надежных туннельных гетеропереходов „ $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ -ПП“. Для преодоления указанных в [7] трудностей в качестве полупроводниковых слоев использовали соединения тетрагональных оксигалогенидов висмута $BiOX$ (X-галоген) – слоистых широкозонных

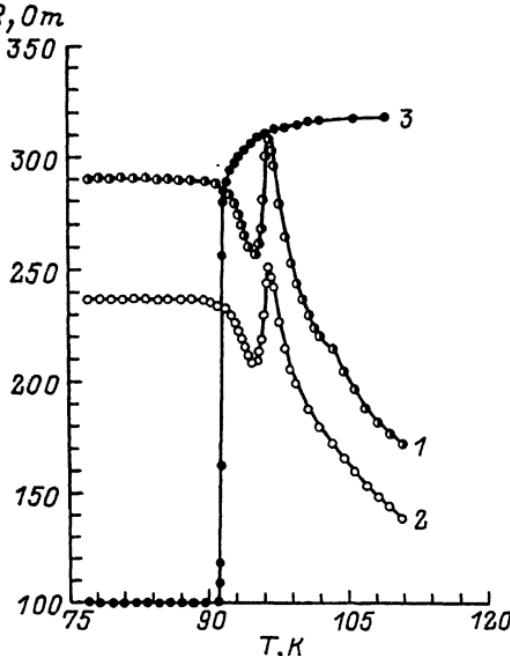


Рис. 1. Температурная зависимость сопротивления: 1 - иттрий-бариевого купрата 123, 2 - гетероперехода „ $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}-BiOCl:Ti$ “ в сквозной геометрии, 3 - гетероперехода „ $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}-BiOCl:Ti$ “ в планарной геометрии.

фотопроводников ($E_g \cong 1.85-3.5$ эВ; R_T (77 К) $\cong 10^{10}-10^{13}$ Ом см, $R_T/R_\phi \cong 10^4-10^6$ при $T=77$ К), обладающих рядом преимуществ.

1. Соединения $BiOX$ кристаллизуются в сингонии $P4/nmm$, близкой по симметрии к P/mmm , в которой кристаллизуется $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$.

2. Согласование параметров кристаллической решетки для базовых плоскостей (001) не хуже 1% ($\Delta a \cong 0.1\%$, $\Delta c \cong 5\%$).

3. Соединения $BiOX$ обладают слоистой структурой, что позволяет получать их в виде монокристаллических ультратонких ($\cong 0.25-0.8$ мкм) слоев на подложках $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$.

4. Оксигалогениды висмута подвержены удовлетворительной интеркаляции (до 3-7 весовых %) 3d- и 4f-элементами, приводящей к устойчивому р-типу проводимости. Степень вырождения $\zeta_P = (E_V - E_F)$ поддается контролю.

В настоящей работе нами исследовались ГП типа „керамический $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$, $T_c = 91$ К“ - „тонкопленочный $BiOCl : Ti$ -слой“. Выбор структуры „ВТСП-керамика - ГП-пленка“ определялся, во-первых, нестабильностью параметров СП-пленок $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ и, во-вторых, ограничениями со стороны эффекта близости.

Слои оксигалогенидов висмута получали методом лазерного импульсного испарения (лазер ЛТИПЧ-500, $\lambda = 0.53$ мкм, $V = 50$ Гц). Поверхность $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ предварительно подвергалась ионно-плаз-

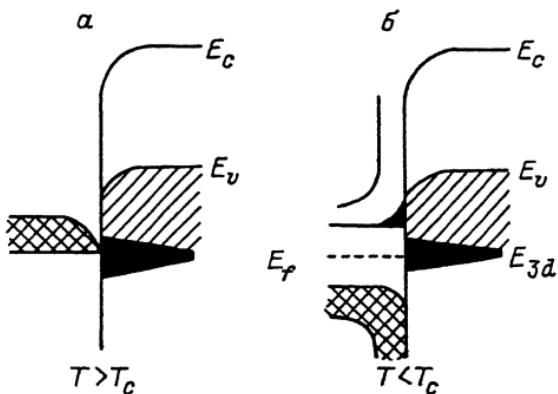


Рис. 2. Модель энергетической диаграммы контакта гетероперехода „ $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ - $BiOCl : Ti$ “: а - $T > T_c$, б - $T < T_c$.

менному травлению в атмосфере кислорода с целью восстановления сверхпроводящих свойств нарушенного приповерхностного слоя. После завершения цикла формирования ГП осуществляли рекристаллизационный отжиг при $T=230\text{--}250$ °С. При этом рентгеноаморфный слой $BiOCl : Ti$ переходил в поликристаллическое состояние.

Особенность температурного поведения сопротивления гетероперехода „ $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ - $BiOCl : Ti$ “ состоит в наличии N -образной аномалии в интервале 85–105 К (рис. 1), причем имеет место идентичный характер зависимости $R(T)$ как собственно ГП в свозной геометрии (кривая 2), так и сопротивления ГП-слоя в планарной геометрии (кривая 3). Кривая 1 на рис. 1 представляет собой температурную зависимость сопротивления $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ ($T_c(R=0)=91$ К) [8].

Детальное рассмотрение температурной зависимости сопротивления ГП в сквозной (кривая 2) и планарной (кривая 3) геометриях показывает, что в обоих случаях в узком температурном интервале вблизи T_c ($\cong 5$ К) сопротивление испытывает скачок, достигая минимума при $T=(T_c+2)$ К. Дальнейшее повышение температуры сопровождается ростом $R(T)$, причем максимум достигается при $T=(T_c+5)$ К. После прохождения максимума сопротивление резко уменьшается, сохраняя экспоненциальный характер хода вплоть до температур 400 К.

Рассмотрим модель зонной диаграммы гетероперехода „ВТСП-полупроводник“ (рис. 2). Механизм токопереноса в $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ носит дырочный характер (носители р-типа локализованы на кислородных вакансиях). ГП с возможностью туннелирования квазичастиц реализуется в случае вырожденного ГП-слоя р-типа [1, 2]. В интервале 77–85 К R_d ГП практически не зависит от T , что связано со значительной глубиной залегания примесных зон Ti^{4+} внутри запрещенной зоны $BiOCl : Ti$ и шунтирующим действием объема ВТСП ($R=0$).

Приложение напряжения V_{tr} смешает уровень Ферми ПП в область края щели сверхпроводника (рис. 2, б). Повышение температуры ПП до 85–98 К инициирует дальнейшее смещение E_F относительно края щели и приводит к туннелированию квазичастиц из объема $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ на свободные состояния примесной (либо валентной) зоны полупроводника. Квазичастицы проникают в ПП-слой на глубину порядка ξ_n , разваливаясь в дальнейшем на пары свободных дырок. В этой связи повышается концентрация основных носителей заряда ПП-слоя и возникают участки падения $R(T)$ (рис. 1).

При $T \geq 95$ –98 К в ПП имеют место следующие процессы:
1) ВТСП выходит в резистивное состояние; 2) величина щели $\Delta_o(T \rightarrow T_c) \rightarrow 0$; 3) обратная инжекция дырок с ПП-слоя в объем $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ с последующей термализацией; 4) эффективный захват дырок на центры прилипания ПП. Все четыре упомянутых процесса приводят к возрастанию сопротивления ПП. В дальнейшем характер $R(T)$ ПП (при $T > 105$ К) носит полупроводниковый характер, т.е. полностью определяется собственно полупроводниковым слоем ПП [8].

Список литературы

- [1] Алфееев В.Н., Неустров Л.Н. // Сверхпроводимость: ФХТ. 1990. Т. 3. № 3. С. 385–391.
- [2] Алфееев В.Н., Неустров Л.Н. // ДАН СССР. 1990. Т. 311. № 5. С. 1106–1109.
- [3] Suzuki M., Fujii T., Morik K. et al. // Jap. J. Appl. Phys. 1988. V. 27. N 10. P. 2003–2004.
- [4] Комашко В.А., Уханов С.А., Юрченко Н.П. // Письма в ЖТФ. 1990. Т. 16. В. 4. С. 9–11.
- [5] Currivitch M., Valles J.M., Sisco-Io Jr.A.-M. et al. // Phys. Rev. Lett. 1989. V. 63. N 9. P. 1008–1011.
- [6] Toshikazu N., Hideaki N., Yoshinobu T. et al. // Jap. J. Appl. Phys. 1987. Pt. 2. V. 26. N 8. P. 1320–1322.
- [7] Венгалис Б., Юкна А., Шикторов Н. // Письма в ЖТФ. 1991. Т. 17. В. 8. С. 60–64.
- [8] Bunda V.W. // Mat. 7 Internat. Conf. of Ferroelectrics. Dijon. France, 1991. Р. 9021.